

HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

when the distal end (42) of the triangular pin (41) has contacted the placement surface (12) is detected; and a parallelism calculation step in which the parallelism between the placement surface (12) of the stage (10) and the holding surface (23) of the mounting tool (22) is calculated on the basis of the first height (HA, HB1) and the second height (HA2, HB2).

(57) 要約: 実装装置における平行度検出方法であって、ステージ(10)の載置面(12)に三角ピン(41)を載置し、実装ツール(22)を下降させて保持面(23)が三角ピン(41)の先端(42)に接した際の実装ツール(22)の第1高さ(HA1, HA2)を検出する第1高さ検出工程と、実装ツール(22)の保持面(23)に三角ピン(41)を保持させ、実装ツール(22)を下降させて三角ピン(41)の先端(42)が載置面(12)に接した際の実装ツール(22)の第2高さ(HA2, HB2)を検出する第2高さ検出工程と、第1高さ(HA, HB1)と第2高さ(HA2, HB2)とに基づいてステージ(10)の載置面(12)と実装ツール(22)の保持面(23)との平行度を算出する平行度算出工程と、を備える。